

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 21 年 1 月 8 日 (2009.1.8)

【公開番号】特開 2001-244253 (P2001-244253A)
 【公開日】平成 13 年 9 月 7 日 (2001.9.7)
 【出願番号】特願 2000-381801 (P2000-381801)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

G 0 2 F 1/13 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/302 1 0 1 G

G 0 2 F 1/13 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 12 月 14 日 (2007.12.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

プラズマ処理を施す液晶表示体用基板を載置する載置台を有する処理室と、この処理室に連結された搬送機構を有する搬送室とを備え、上記処理室は上記搬送機構と上記載置台との間で上記液晶表示体用基板を受け渡し受け渡し機構を有し、上記受け渡し機構は上記載置台の近傍に設けられ、更に、上記受け渡し機構は、正逆回転可能で且つ昇降可能な支持ロッドと、この支持ロッドの上端から水平に張り出す液晶表示体用基板受け渡し用支持部材と、この受け渡し用支持部材を収納する筐体とを有することを特徴とする液晶表示体基板用プラズマ処理装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 0】

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項 1 に記載の液晶表示体基板用プラズマ処理装置は、プラズマ処理を施す液晶表示体用基板を載置する載置台を有する処理室と、この処理室に連結された搬送機構を有する搬送室とを備え、上記処理室は上記搬送機構と上記載置台との間で上記液晶表示体用基板を受け渡し受け渡し機構を有し、上記受け渡し機構は上記載置台の近傍に設けられ、更に、上記受け渡し機構は、正逆回転可能で且つ昇降可能な支持ロッドと、この支持ロッドの上端から水平に張り出す液晶表示体用基板受け渡し用支持部材と、この受け渡し用支持部材を収納する筐体とを有することを特徴とするものである。